(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-58436 (P2000-58436A)

(43)公開日 平成12年2月25日(2000.2.25)

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)	
HO1L 21/027	19900 3122	H01L 21/30	512 2H087	
G 0 2 B 13/24		G 0 2 B 13/24	5 F O 4 6	
G03F 7/20	5 2 1	G03F 7/20	5 2 1	
0001 1,=1		H 0 1 L 21/30	5 1 5 G	
		審査請求 未請求	請求項の数4 FD (全 5 頁)	
(21)出願番号 特願平10-239562		(71)出願人 000004112 株式会社ニコン		
(72)発明者 藤		(72)発明者 藤島 洋	代田区丸の内3丁目2番3号 株	

(72)発明者 松本 宏一

(74)代理人 100094329

式会社ニコン内

弁理士 猪熊 克彦

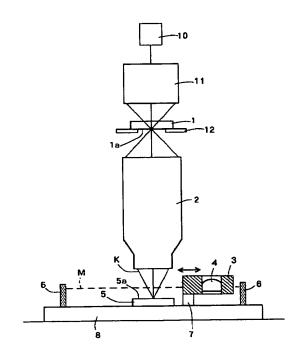
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 投影露光装置及び露光方法

(57)【要約】

【課題】投影光学系を液浸状態で使用した場合でも、通常状態で使用した場合と比べて、投影光学系による結像位置と、光軸付近の結像性能の変化の少ない投影露光装置及び露光方法を提供する。

【解決手段】原版1上に描画されたパターン1 a を基板5の感光面5 a に転写する投影光学系2を有する投影解光装置において、投影光学系2の最も基板5側のレンズ面と感光面5 a との空間に、補助レンズ4が挿脱可能に配置され、補助レンズ4の下面と感光面5 a との空間は、液浸可能に形成され、補助レンズ4の原版1側レンズ面の曲率半径R」は、原版1側レンズ面から感光面5 a までの光軸2上の距離 d 」にほぼ等しくなるように形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】原版上に描画されたパターンを基板の感光 面に転写する投影光学系を有する投影解光装置におい て

前記投影光学系の最も基板側のレンズ面と前記感光面と の空間に、補助レンズが挿脱可能に配置され、

阪補助レンズの下面と前記感光面との空間は、液浸可能 に形成され。

前記補助レンズの原版側レンズ面の曲率半径は、該原版 側レンズ面から前記感光面までの光軸上の距離にほぼ等 しくなるように形成されたことを特徴とする投影解光装 價。

【請求項2】前記補助レンズの基板側レンズ面の曲率半径は、該基板側レンズ面から前記感光面までの光軸上の距離にほぼ等しくなるように形成されたことを特徴とする請求項1記載の投影露光装置。

【請求項3】原版上に描画されたパターンを基板の感光 面に転写する投影光学系を有する投影露光装置におい て、

前記投影光学系の最も基板側のレンズ面の曲率半径は、 該基板側のレンズ面から前記感光面までの光軸上の距離 にほぼ等しくなるように形成されたことを特徴とする投 影露光装置。

【請求項4】請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の投影露光装置を用いて露光する方法において、

前記原版を所定の露光光で照明する照明工程と、

前記投影光学系を介して前記原版のパターン像を前記基 板の感光面に露光する露光工程とを含むことを特徴とす る露光方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、原版上に描画されたパターンを基板上に焼付転写する投影光学系を有する 投影露光装置及び露光方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、感光性基板としてのウエハに転写されるパターンの微細化が望まれている。これを達成するためには、露光波長の短波長化を図るか、投影光学系の開口数の増大化を図るかの2つの方法が考えられる。従来より、これらのうち投影光学系の開口数の増大化を図る方法として、被浸式の投影露光装置が提案もウエスを図る方法として、被浸式の投影露光装置が提案もウエスのの空間(以後、作動空間をいかがある。からである。近日である。近日である。近日である。近日である。近日であるのに対して、例えば、油の旧折率が1.0であるのに対して、例えば、油の旧折率は約1.6である。このため、作動空間の全部又はウエハ側の部分空間を、このように屈折率の高い体にで換すれば、投影光学系のウエハ側の開口数を大きく

し、露光パターンの微細化を図ることができる。 【0003】

【発明が解決しようとする課題】上記従来の被浸式の投 影響光装置においては、作動空間を空気等の気体とする 通常使用時と、パターンの徴細化を図り作動空間の全部 又はウエハ側の部分空間を液体とする液浸使用時とで、 同等の結像性能を確保できなかった。例えば、作動空間 のウエハ側部分空間を液体とする液浸時の使用方法とし て、平行平板ガラスを気体と液体の境界に設置する場合 を考える。このような場合、以下の3つの不具合が発生 する

【0004】1つめは、液没使用時、平行平板ガラスの 入射面での光の屈折によって、投影光学系による結像位 置がずれる不具合である。そのため、焦点距離を確保す るように、投影光学系又はウエハを移動させる必要があ る。そして、その液浸使用時の条件によっては、結像位 置をウエハ上に合わせられなくなる場合がある。2つめ は、液浸使用時に気体と液体の境界に設置される平行平 板ガラスによって、球面収差が生じる不具合である。こ れによって、液没使用時には結像性能が悪くなる。3つ めは、環境変動により液浸使用時の結像性能や結像位置 の変化が大きくなる不具合である。すなわち、液体の屈 折率は、気体の屈折率に比べて、温度変化等の環境変動 によって大きく変化するため、結像性能や結像位置が安 定しない。したがって本発明は、投影光学系を液浸状態 で使用した場合でも、通常状態で使用した場合と比べ て、投影光学系による結像位置と、光軸付近の結像性能 の変化の少ない投影露光装置及び露光方法を提供するこ とを課題とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は上紀課題を解決するためになされたものであり、すなわち、添付図面の図1及び図2に付した符号をカッコ内に付記すると、本発明は、原版(1)上に描画されたパターン(1a)を基板(5)の感光面(5a)に転写する投影光学系

- (2) を有する投影露光装置において、投影光学系
- (2) の最も基板(5) 側のレンズ面と感光面(5 a)との空間に、補助レンズ(4)が挿脱可能に配置され、補助レンズ(4)の下面と感光面(5 a)との空間は、液浸可能に形成され、補助レンズ(4)の原版(1)側レンズ面の曲率半径(R_1)は、原版(1)側レンズ面から感光面(5 a)までの光軸(Z)上の距離(d_1)にほぼ等しくなるように形成されたことを特徴とする投影露光装置である。その際、更に添付図面の図3に付した符号をカッコ内に付記すると、補助レンズ(4)の基板(5)側レンズ面の曲率半径(R_2)は、基板(5)側レンズ面から感光面(5 a)までの光軸(Z)上の距離(d_2)にほぼ等しくなるように形成されることが好ましい。

【0006】また本発明は、添付図面の図1及び図4に

付した符号をカッコ内に付記すると、原版(1)上に描画されたパターン(1 a)を基板(5)の感光面(5 a)に転写する投影光学系(2)を有する投影露光装置において、投影光学系(2)の最も基板(5)側のレンズ面の曲率半径(R_2)は、基板(5)側のレンズ面から感光面(5 a)までの光軸(Z)上の距離(Z)にほぼ等しくなるように形成されたことを特徴とする投影露光装置である。また本発明は、添付図面の図1に付した符号をカッコ内に付記すると、上述の構成の投影露光装置を用いて露光する方法において、原版(1)を所定の露光光で照明する照明工程と、投影光学系(2)を介して原版(1)のパターン像(1 a)を基板(5)の感光面(5 a)に露光する露光工程とを含むことを特徴とする露光方法である。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面によって説明する。図1、図2にて、本発明による投影露光装置の第1実施例を示す。図1は、本発明の第1実施例による通常使用時での投影露光装置を示す図である。本第1実施例は、照明工程と露光工程を含む露光方法にて、レチクル1のパターン面1aの像をウエハ5の像面5a(感光面)に結像する。すなわち、KrFエキシマレーザー光源等の光源10から発した光束は、照明光学系11を経て、レチクルステージ12上に載置された原版としてのレチクル1のパターン面1aから発した露光光は、投影光学系2を介して、XYステージ8上に載置されたウエハ5の像面5aに、パターン面1aの像を結像する。なお、通常使用時とは、作動空間が、空気のみの状態をいう。

【0008】ここで、XYステージ8上には、回転軸7 を介在して、レンズホルダ3に保持された補助レンズ4 が設置されている。この補助レンズ4は、回転軸7を中 心に回転可能となっている。そして、図1に示す位置か 5180°回転すると、補助レンズ4は、投影光学系2 の真下に配置される。このとき、補助レンズ4の光軸 は、投影光学系2の光軸と一致する。また、XYステー ジ8上には、箱形状の液体遮蔽板6が設置されている。 図1では、簡単のため、液体遮蔽板6の断面のみ示す。 そして、液体遮蔽板6に囲まれた空間に、油等の液体を 入れて、作動空間のウエハ5側部分空間を液体とするこ とができる。本第1実施例の投影露光装置を液浸状態に て使用する場合、補助レンズ4を投影光学系2の真下に 配置し、液体遮蔽板6内に液体を入れる。このとき、補 助レンズ4の上面(レチクル1側の面)と、投影光学系 2の下面(最もウエハ 5 側の面)との間は、空気とな る。そして、補助レンズ4の下面(ウエハ5側の面) と、ウエハ5との間は、液体となる。図1の破線Mは、 空気と液体の境界線を示す。

【0009】図2は、本発明の第1実施例による液浸使

用時での投影露光装置において、補助レンズ4の近傍を拡大して示した図である。前述したように、液浸使用時では、補助レンズ4の上面側の空間は液体上となっている。また、本第1実施例における補助レンズ4の屈折率は、液体上の屈折率とほぼ等しい値となっている。補助レンズ4の上面形状は、ウエハ5上の像面5aの中心に結像するすべての光線Kが垂直に入射するような形状となっている。すなわち、補助レンズ4の上面の曲率中心が、補助レンズ4及び液体上がない通常使用時の像面5aの中心と一致している。そして、補助レンズ4の上面の曲率半径R1は、次式を満たす。

 $R_1 = d_1 \tag{1}$

d₁:補助レンズ4上面からウエハ像面5aまでの光軸 2上の距離

【0010】一方、補助レンズ4の下面形状は、平面形状となっている。前述したように、補助レンズ4と液体 Lの屈折率は等しいため、像面5aの中心付近に結像する全ての光線Kは、補助レンズ4の下面部においても、 上面部と同様に、ほとんど屈折しない。したがって、液 浸使用時の収束半角は、通常使用時の収束半角と等しく なる。このとき、投影光学系2のウエハ5側の開口数N Aは、

 $NA = n s i n \theta$

n:液体の空気に対する屈折率

θ:収束半角

で求まる。また、分解能△rは、次式で求まる。

 $\Delta r = k \lambda_0 / N A$

λο: 露光光の空気中での屈折率

k:定数

【0011】したがって、液浸使用時は、通常使用時と比べて、開口数をn倍、像面5 a 中心付近における分解能を1/nに向上することができる。また、本第1実施例では、像面5 a の中心に結像する全ての光線Kは、補助レンズ4によっては屈折しないため、球面収差が発生しない。更に、補助レンズ4の色分散と液体Lの色分散とが等しい場合には、軸上色収差も発生しない。これにより、光軸2付近の像面5 a において、液浸使用時であっても、通常使用時における結像性能がほぼ保たれる。更に、液浸使用時と通常使用時とで、投影光学系5による結像位置の変化もない。

【0012】次に、図3にて、本発明による投影露光装置の第2実施例を示す。本第2実施例は、補助レンズ4の形状のみ、前記第1実施例と異なる。図3は、本発明の第2実施例による液浸使用時での投影露光装置において、補助レンズ4の近傍を拡大して示した図である。本第2実施例の補助レンズ4の上面部の形状は、前記第1実施例の補助レンズ4の上面部の形状と等しい。すなわち、上面部において(1)式の関係が成り立つ。

【0013】一方、前記第1実施例の補助レンズ4の下

面部が平面形状であるのに対して、本第2实施例の補助レンズ4の下面部の形状は曲面形状となっている。そして、その下面形状は、上面形状と同様に、ウエハ5上の像面5aの中心に結像する全ての光線Kが垂直に入射するような形状となっている。すなわち、補助レンズ4の下面の曲率中心が、通常使用時の像面5aの中心と一致している。そして、補助レンズ4の下面の曲率半径R2は、次式を満たす。

 $R_2 = d_2 \tag{2}$

d₂: 補助レンズ4下面からウエハ像面5 a までの光軸 2. トの距離

【0014】本第2実施例によれば、補助レンズ4と液体Lの屈折率が異なるときや、温度変化等の環境変動によって液体Lの屈折率が変化するときであっても、収差や結像位置の変化が少ない。すなわち、像面5aの中心に結像する全ての波長の光線Kは、補助レンズ4の下面においても、液体Lの屈折率や色分散に関わらず屈折しない。したがって、本第2実施例においても、前配第1実施例と同様に、液浸使用時に高い分解能を得ることができる。また、通常使用時と液浸使用時とを比較しても、投影光学系2による結像位置が変化せず、像面5aでの軸上色収差や球面収差の変化もなく、光軸Z付近の像面5aでの結像性能が維持される。更に、温度変化等によって液体Lの屈折率が変化しても、結像位置、軸上色収差や球面収差の変化はない。

【0015】次に、図4にて、本発明による投影解光装置の第3実施例を示す。前記第1、第2実施例では液浸使用時に作動空間のウエハ5側部分空間の一部を液体としたが、本第3実施例では、液浸使用時に作動空間の全部を液体とする。すなわち、液浸使用時には、投影光学系2の最もウエハ5側の面が、液体に浸されることになる。したがって、本第3実施例の投影解光装置は、図1の液体遮蔽板6の上面が、投影光学系2の下面より高くなければならない。更に、前配第1、第2実施例の液浸使用時に用いる図1のレンズホルダ3、補助レンズ4、回転軸7は、不要となる。

【0016】図4は、液浸使用時において、投影露光装置の投影光学系2の最もウエハ5側の面を拡大して示した図である。投影光学系2の最もウエハ5側の面の形状は、前記第2実施例の補助レンズ4の下面部の形状と等

しい。すなわち、下面部において (2) 式の関係が成り立つ。一方、通常使用時においても、図4に示す投影光学系2を用いることになるが、液浸使用時と同様に、像面5aの中心付近に結像する全ての光線Kの屈折は生じない。本第3実施例においても、前記第2実施例と同様に、液浸使用時に高い分解能を得ることができる。また、通常使用時と液浸使用時とを比較しても、投影光学系2による結像位置が変化せず、像面5aでの軸上色収差や球面収差の変化もなく、光軸2付近の像面5aでの結像性能が維持される。更に、温度変化等によって液体しの屈折率が変化しても、結像位置、軸上色収差や球面収差の変化はない。

[0017]

【発明の効果】以上のように本発明では、投影腐光装置を通常状態と液浸状態とで共用することができる。そして、液浸使用時においても、結像位置や光軸付近の結像性能がほとんど変化しない投影露光装置を提供することができる。更に、液体の屈折率の変化の影響の少ない投影露光装置及び露光方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例による投影露光装置を示す 図である。

【図2】本発明の第1実施例による投影露光装置の液没 使用時の状態を示す図である。

【図3】本発明の第2実施例による投影露光装置の液浸 使用時の状態を示す図である。

【図4】本発明の第3実施例による投影露光装置の液浸使用時の状態を示す図である。

【符号の説明】

1 ··· レチクル 1 a ··· パターン面

2…投影光学系

3…レンズホルダ

4 …補助レンズ

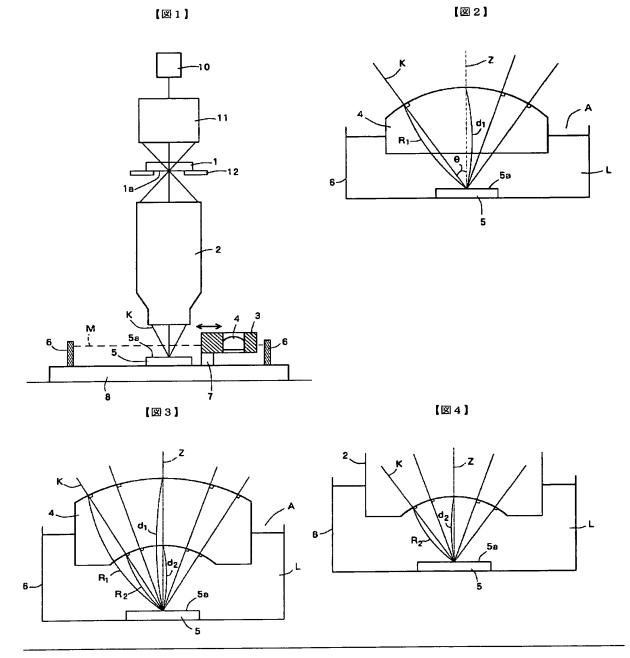
5…ウエハ5 a …像面6…液体遮蔽板7 …回転軸8…XYステージ1 0 …光源

11…照明光学系

12…レチクルステージ

 Z···光軸
 K···光線

 A···気体
 L···液体



フロントページの続き

F ターム(参考) 2H087 KA21 LA00 NA04 PA01 PB01 QA01 QA03 5F046 BA03 CA04 CB12 CB25 CB26 CB27 DA13